Результаты вступительного испытания Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и наноэлектронике 16.08.2019 (минимальный балл, необходимый для поступления на обучение - 40)

| | (минимальный чалл, псобходимый для поступления на обучение - 40) | | | |
|----------------|--|------|-------------------|--|
| ID Абитуриента | Вступительное испытание | Балл | Тип Балла | |
| | Физические основы вакуумных и | | | |
| 59527 | криогенных технологий в микро- и наноэлектронике | 90 | Экзамен ЯрГУ | |
| | | | | |
| 50025 | Физические основы вакуумных и | 90 | Ormon core ClastV | |
| 59035 | криогенных технологий в микро- и наноэлектронике | 90 | Экзамен ЯрГУ | |
| | Физические основы вакуумных и | | | |
| 59057 | криогенных технологий в микро- и наноэлектронике | 89 | Экзамен ЯрГУ | |
| | | | 1 | |
| | Физические основы вакуумных и | | | |
| 59526 | криогенных технологий в микро- и наноэлектронике | 89 | Экзамен ЯрГУ | |
| | | | | |
| 50101 | Физические основы вакуумных и | 00 | 0 4 57 | |
| 59181 | криогенных технологий в микро- и наноэлектронике | 88 | Экзамен ЯрГУ | |
| | Физические основы вакуумных и | | | |
| 58613 | криогенных технологий в микро- и наноэлектронике | 87 | Экзамен ЯрГУ | |
| | r | | F - | |
| | Физические основы вакуумных и | | | |
| 59182 | криогенных технологий в микро- и наноэлектронике | 80 | Экзамен ЯрГУ | |
| | | | | |
| -0 - | Физические основы вакуумных и | 00 | 0 0 0 | |
| 58573 | криогенных технологий в микро- и наноэлектронике | 80 | Экзамен ЯрГУ | |
| | Физические основы вакуумных и | | | |
| 58909 | криогенных технологий в микро- и наноэлектронике | 75 | Экзамен ЯрГУ | |
| 30,07 | April Chinasis Telinosis in a similar in minessiem permite | 7.5 | Экзамен этрт у | |
| | Физические основы вакуумных и | | | |
| 59395 | криогенных технологий в микро- и наноэлектронике | 65 | Экзамен ЯрГУ | |
| | | | | |
| | Физические основы вакуумных и | | | |
| 58611 | криогенных технологий в микро- и наноэлектронике | 63 | Экзамен ЯрГУ | |
| | Физические основы вакуумных и | | | |
| 60103 | физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и наноэлектронике | 50 | Экзамен ЯрГУ | |
| 00103 | пристепния телнологии в микро и напоэлектронике | 30 | OKSUMOII AIPI 5 | |
| | Физические основы вакуумных и | | | |
| 60419 | криогенных технологий в микро- и наноэлектронике | 45 | Экзамен ЯрГУ | |